

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成27年6月18日(2015.6.18)

【公開番号】特開2015-39040(P2015-39040A)

【公開日】平成27年2月26日(2015.2.26)

【年通号数】公開・登録公報2015-013

【出願番号】特願2014-238132(P2014-238132)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/304 6 5 1 Z

H 01 L 21/304 6 4 7 Z

【手続補正書】

【提出日】平成27年4月28日(2015.4.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

本発明の処理装置は、

被処理基板が高圧流体により処理される処理空間を区画形成し、被処理基板が当該被処理基板の面に沿った方向に搬送される搬入出口を有する処理容器と、

被処理基板を保持して前記搬入出口を介して前記処理空間に搬入出するための基板ホルダーと、

この基板ホルダーの端部に設けられ、当該基板ホルダーが処理空間に進入したときに前記搬入出口を気密に塞ぐための蓋体と、

前記基板ホルダーに保持された被処理基板を処理容器に対して搬入出させるために前記蓋体を進退させる駆動部と、

前記蓋体が前記処理容器内の圧力により当該処理容器側から後退することを規制するための規制機構と、

前記蓋体と前記処理容器の外面との間に前記搬入出口を囲んだ状態で介在するように設けられ、高圧流体に対して耐食性を有する材質により構成された第1のシール部材と、

前記搬入出口から見て前記第1のシール部材よりも外側に離れた位置において、前記蓋体と前記処理容器の外面との間に前記搬入出口を囲んだ状態で介在するように設けられた第2のシール部材と、を備えたことを特徴とする。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

本発明の処理方法は、

被処理基板が高圧流体により処理される処理空間を区画形成し、被処理基板が当該被処理基板の面に沿った方向に搬送される搬入出口を有する処理容器を用い、

基板ホルダーに被処理基板を保持して前記搬入出口を介して前記処理空間に搬入し、この基板ホルダーの端部に設けられた蓋体により前記搬入出口を気密に塞ぐ工程と、

次いで、前記蓋体が前記処理容器内の圧力により当該処理容器側から後退することを規

制する工程と、

前記蓋体と前記処理容器の外面との間に、高圧流体に対して耐食性を有する材質により構成された第1のシール部材を、前記搬入出口を囲んだ状態で介在させると共に、前記搬入出口から見て前記第1のシール部材よりも外側に離れた位置において、第2のシール部材を前記搬入出口を囲んだ状態で前記蓋体と前記処理容器との間に介在させることにより、前記処理容器内と外部とを気密にシールする工程と、

その後、被処理基板に対して高圧流体を用いて処理を行う工程と、を含むことを特徴とする。